(11)Publication number:

10-329083

(43)Date of publication of application: 15.12.1998

(51)Int.CI.

B25J 19/02

(21)Application number: 09-139770

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

29.05.1997

(72)Inventor: YAJIMA SATOSHI

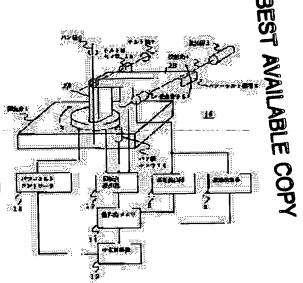
AOKI KAZUHIKO

(54) ORIGIN DETECTING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To detect the mechanism origin of a pan tilt mechanism accurately.

SOLUTION: Projection light 4 is radiated from a parallel direction to a shaft which is orthogonal to a pan shaft 6 of a pan tilt mechanism 2 by a projector 3. The projection light 4 is interrupted by the pan tilt mechanism 2, and an interruption detector 8 transmits interruption trigger by an output signal from a light receiving element 5 at that time. When the light is transmitted again after it is interrupted and received by the light receiving element 5, a transmission detector 9 transmits transmission trigger by the output signal of the light receiving element 5 at that time. By detecting a rotational angle around the pan shaft 6 and a rotational angle around a tilt shaft 7 at the time of triggering the interruption trigger and the transmission trigger respectively by a rotational angle detector 10, and obtaining the mean value of the respective rotational angles by a midpoint computer 12, it is possible to determine a mechanism origin.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

29.05.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2817736

[Date of registration]

21.08.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-329083

(43)公開日 平成10年(1998)12月15日

(51) Int.Cl.⁶

B 2 5 J 19/02

識別記号

FΙ

B 2 5 J 19/02

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顯平9-139770

(22) 出願日

平成9年(1997)5月29日

(71) 出顧人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 谷嶋 悟志

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 青木 一彦

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

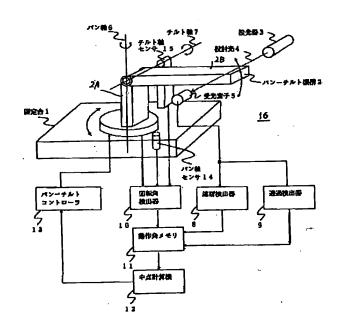
(74)代理人 弁理士 山川 政樹

(54) 【発明の名称】 原点検出装置

(57)【要約】

【課題】 パンーチルト機構の機構原点検出を正確に行う。

【解決手段】 投射器3によりパンーチルト機構2のパン軸6と直交する軸に平行な方向から投射光4を発する。この投射光4は、パンーチルト機構2によって遮断され、このときの受光素子5による出力信号によって遮断検出器8が遮断トリガを送出する。一方、遮断された後再透過して受光素子5により受光されると、このときの受光素子5の出力信号によって透過検出器9が透過トリガを送出する。遮断トリガと透過トリガのトリガ時におけるパン軸6回りの回転角とチルト軸7回りの回転角をそれぞれ回転角検出器10によって検出し、各々の回転角の平均値を中点計算機12で求め、機構原点を決定する。



L)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 パンーチルト機構を有する2自由度の関 節機構の原点を検出する装置において、

前記パンーチルト機構のパン軸と直交する軸に平行な方向から投射光を発する投光器と、前記投射光が前記パンーチルト機構によって遮断されたときにトリガを出力する遮断検出器と、前記遮断された投射光が前記パンーチルト機構の移動によって再び透過したときにトリガを出力する透過検出器と、前記2種のトリガに応じてトリガ時のそれぞれ2種のパン軸回り回転角を検出する回転角検出器と、前記2種のパン軸回りとチルト軸回りの回転角を記憶する角度メモリと、前記パン軸およびチルト軸回りのそれぞれ2種の回転角の平均を求める計算手段とを備えたことを特徴とする原点検出装置。

【請求項2】 請求項1記載の原点検出装置において、 パンーチルト機構により投射光が遮断、透過する度にト リガを出力する投射光検出器を備えたことを特徴とする 原点検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は産業用ロボットに係り、特にパンーチルト機構を有する2自由度の関節機構の原点を検出する装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来の産業用関節ロボットでは、特開平4-310393号公報の「産業用ロボット」(以下、 先行発明1という)に記載されるように、各関節軸に取付けた原点検出センサを用いて機構原点を特定する方法や、特開平5-280927号公報の「レーザスリット光の位置検出方法」(以下、先行発明2という)に記載されるように多自由度ロボットの先にカメラ等の画像処理手段を取付け、基準位置とのずれを数学的に求める方法が知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記した先行発明1においては、原点センサによって検出される原点と機構そのものの機構原点は、センサの取付け誤差、機構の組立て誤差等により正確に一致しないという問題があった。一方、先行発明2は、複雑な手順とカメラ、画像処理装置等の高価な計測装置が必要であるという問題があった。

【0004】本発明は上記した従来の問題を解決するためになされたもので、その目的とするところは、パンーチルト機構の機構原点検出を単純でかつ正確に行うことができるようにした原点検出装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に本発明は、パンーチルト機構を有する2自由度の関節 機構の原点を検出する装置において、前記パン-チルト 機構のパン軸と直交する軸に平行な方向から投射光を発 する投光器と、前記投射光が前記パン-チルト機構によ って遮断されたときにトリガを出力する遮断検出器と、 前記遮断された投射光が前記パンーチルト機構の移動に よって再び透過したときにトリガを出力する透過検出器 と、前記2種のトリガに応じてトリガ時のそれぞれ2種 のパン軸回り回転角と、2種のチルト軸回り回転角を検 出する回転角検出器と、前記2種のパン軸回りとチルト 軸回りの回転角を記憶する角度メモリと、前記パン軸お よびチルト軸回りのそれぞれ2種の回転角の平均を求め る計算手段とを備えたことを特徴とする。本発明におい ては、投射光がパンーチルト機構によって遮断されたと きと再透過したときに遮断トリガと透過トリガを出力 し、これらのトリガに応じてトリガ時のパン軸およびチ ルト軸回りの回転角を検出しているので、取付け誤差、 調整誤差を含むセンサを使用する必要がなく、関節機構 の機構原点を正確に測定することができる。また、カメ ラ、画像処理装置等を必要としない。

【0006】また、本発明は、上記発明において、パンーチルト機構により投射光が遮断、透過する度にトリガを出力する投射光検出器を備えたことを特徴とする。本発明においては、投射光の遮断と透過を1つの投射光検出器で検出しているので、回路調整工数を少なくすることができる。

[0007.]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図面に示す実施の 形態に基づいて詳細に説明する。図1は本発明に係る原 点検出装置の第1の実施の形態を示す概略構成図であ る。1は固定台、2は固定台1上に設置されたパンーチ ルト機構で、このパンチルト機構2は、固定台1上に垂 直なチルト軸6回りに回動自在に設けられたパン2A と、パン2の上端にチルト軸6と直交する水平なチルト 軸7回りに揺動自在に設けられたチルト2Bとで構成さ れている。3,5はチルト3Bの両側の空間に対向して 配置された投光器および受光素子である。投光器3は、 パン-チルト機構2のパン軸6と直交する軸に平行な方 向から投射光4を受光素子5に向けて発する。この投射 光4は、その光路上にチルト2Bが位置していると遮断 され、位置していないときには受光素子5によって受光 され、これによってパン-チルト機構2による投射光4 の遮断、透過が検出される。遮断検出器8と透過検出器 9は受光素子5からの信号を受け遮断トリガと、透過ト リガをそれぞれ発生する検出回路である。パンーチルト コントローラ13はパンーチルト機構2をパン軸6回り に回転させたり、チルト2Bをチルト軸7回りに揺動さ せるコントローラである。回転角検出器10はパン軸 6、チルト軸7の回転角を検出する検出器で回転角を動 作角メモリ11に出力する。動作角メモリ11は遮断検 出器8、透過検出器9から出力する遮断トリガ、透過ト

リガに併せて回転角をメモリに格納するメモリである。 中点計算機12は動作角メモリ11に格納された回転角 の平均を求める計算機であり、計算した平均値をパンー チルトコントローラ13へ出力する。パン軸センサ1 4、チルト軸センサ15は初期化時に固定台1とパンー チルト機構2の基準点を決定するセンサで、これらによって原点検出装置16を構成している。

【0008】次に、原点検出装置16の動作について説明する。初めに初期化動作として、固定台1とパンーチルト機構2との基準点を求めるためにパンーチルトコントローラ13でパンーチルト機構2をパン軸6回りに回転させるとともにチルト2Bをチルト軸7回りに揺動させ、パン軸センサ14、チルト軸センサ15で検出される基準点へパンーチルト機構2を移動させる。この時、パン軸センサ14およびチルト軸センサ15から出力される検出信号をトリガとして回転角検出器10のエンコーダカウンタをリセットする。

【0009】図2は第1の原点検出動作時のパンーチル ト機構2の軌跡を示す図である。第1の原点検出は、パ ンーチルトコントローラ13でパンーチルト機構2をパ ン軸6回りに回転させるとともにチルト2Bをチルト軸 7回りに揺動させ、チルト2Bが投射光4を十分遮断で きる任意の位置へ移動させる。ここでチルト軸7を固定 し、パン軸6回りに回転させると、パンーチルト機構2 はチルト2Bの先端が円弧状の軌跡を描き、点aで投射 光4を遮断し、点bで再び透過する。 受光素子5は投射 光4の光量に応じて電圧を発生する素子、例えば太陽電 池等で実現できる。遮断検出器8、透過検出器9は受光 素子5の出力を増幅し、遮断検出器8、透過検出器9の 基準電圧と比較して遮断トリガ、透過トリガをそれぞれ 発生させる。遮断トリガ、透過トリガは回転角検出器1 Oで検出されるパン軸6の基準点に対するa点、b点の 回転角を角度メモリ11へ格納する。格納された動作角 の平均値を中点計算機12で計算し第1の原点である中 点cを決定する。

【0010】図3は第2の原点検出動作時のパンーチルト機構2の軌跡を示す図である。第2の原点検出はパンーチルトコントローラ13でパンーチルト機構2をパン軸6回りに回転させ中点cまで移動させる。ここで、パン軸6を固定し、チルト2Bを揺動させると、チルト2Bの先端はチルト2Bを側方から見た場合円弧状の軌跡を描くが、前方から見た場合は投影面上において上下方向に往復直線軌跡を描くため、点dで投射光4を遮断し、点dで再び透過する。受光素子5は投射光4の光量に応じて電圧を発生する。遮断検出器8、透過検出器9は受光素子5の出力を増幅し、それぞれ遮断検出器8、透過検出器9の基準電圧と比較して遮断トリガ、透過トリガをそれぞれ発生させる。遮断トリガ、透過トリガをそれぞれ発生させる。遮断トリガ、透過トリガは回転角検出器10で検出されるチルト軸7の基準点に対するd点、d,点の回転角を角度メモリ11へ格納

する。格納された動作角の平均値を中点計算機12で計算し第2の原点である中点eを決定する。第1の原点である中点c、第2の原点である中点eによってパンーチルト機構2の機構原点が決定する。

【0011】図4は回転角検出器10の動作を示すプロック図である。回転角検出器10はインクリメンタルエンコーダ101,102と、エンコーダカウンタ103,104から構成される。インクリメンタルエンコーダ101,102はパン軸6およびチルト軸7の回転に応じて回転検出信号を出力する。エンコーダカウンタ103,104は初期化時にパン軸センサ14、チルト軸センサ15によって検出した固定台1とパンーチルト機構2の基準点からの回転角の回転検出信号をカウントし算出する。

【0012】図5は遮断検出器8の動作を示すブロック図である。遮断検出器8は増幅器801、比較器802、基準電圧804から構成される。増幅器801は受光素子5からの遮断情報を含んだ検出電圧を増幅する。比較器802は増幅した検出電圧と基準電圧804を比較し、遮断トリガ803を発生させる。

【0013】図6は透過検出器9の動作を示すブロック図である。透過検出器9は増幅器901、比較器902、基準電圧904から構成される。増幅器901は受光素子5からの透過情報を含んだ検出電圧を増幅する。比較器902は増幅した検出電圧と基準電圧904を比較し、遮断トリガ903を発生させる。

【0014】図7は動作角メモリ11の動作を示すブロック図である。動作角メモリ11は4つのメモリ111、112、113、114から構成される。メモリ11、112、113、114は第1の原点検出時、第2の原点検出時に遮断トリガ803、透過トリガ903のトリガ信号を受けカウンタ103、104の動作角を格納する。

【0015】このように本発明に係る原点検出装置1においては、投射光4がパンーチルト機構2によって遮断されたときと再透過したときを受光素子5によって検出し、その検出信号に基づいて遮断検出器8と透過検出器9が遮断トリガと透過トリガをそれぞれ出力し、これらのトリガに応じてトリガ時のパン軸6およびチルト軸7回りの回転角を検出することにより、パンーチルト機構2の機構原点を決定するので、上記した先行発明1における原点センサを必要とせず、関節機構の機構原点を正確に測定することができる。また、投光器と受光素子を用いているので、カメラ、画像処理装置等を必要とせず、装置の製造コストを低減することができる。

【0016】図8は本発明の第2の実施の形態を示す概略構成図である。本実施の形態では受光素子5の出力先として1つの投射光検出器20を設け、この検出器20によって投射光の遮断、透過の度にトリガを出力させるようにしている。

【0017】図9は投射光検出器20の動作を示すブロ ック図である。投射光検出器20は増幅器201、比較 器202、遅延回路203、基準電圧204、排他論理 和回路205から構成される。受光素子5の出力電圧は 投射光検出器20の増幅器201で増幅される。増幅器 201で増幅された信号は比較器202で基準電圧20 4と比較され遮断、透過情報をエッジに持つ矩形波信号 に変換される。矩形波信号は排他的論理和回路205と 遅延回路203に送られる。遅延回路203は矩形波を Δ t だけ遅らせ排他的論理和回路205に出力する。排 他的論理和回路205は2つの矩形波から遮断、透過情 報を持つ投射光トリガ206を生成し、動作角メモリ1 1へ送りパンーチルト軸の回転角を格納することで上記 した実施の形態と同様に機構原点eを定めることができ る。なお、その他の構成は上記した実施の形態と同一で あるため、同一構成部材については同一符号をもって示 し、その説明を省略する。

【0018】このような構成においては、1つの透過光 検出器20によってトリガを発生させるようにしている ので、検出器および回路調整等の工数を削減することが できる。

【0019】図10は本発明の第3の実施の形態を示す 概略構成図である。本実施の形態においては、1関節当 たり2自由度を持つが、2つの駆動アクチュエータが独 立でなく、互いに干渉しつつ関節の2自由度動作を駆動 する例を示している。このような2自由度動作は、一例 として斜板駆動機構と自在継手を組み合わせることで実 現できる。

【0020】図10に示した例では、関節機構30は1 関節に対してX軸31とY軸32の2つの駆動軸を持っ ている。初めに初期動作として、関節機構30の基準点 を求めるために関節コントローラ40でX軸アクチュエ ータ33とY軸アクチェエータ34を回転させ、X軸セ ンサ35、Y軸センサ36で検出される基準点に関節機 構30を移動させる。この時X軸センサ35、Y軸セン サ36から出力される検出信号をトリガとして回転角検 出器10内のエンコーダカウンタをリセットする。

【0021】図11は第1の原点検出動作時の関節機構30の軌跡を示す図である。第1の原点検出は関節コントローラ40で関節機構30を回転、揺動させ、投射光4を十分遮断できる任意の位置へ移動させる。ここで、X軸アクチュエータ33とY軸アクチュエータ34を等速同方向に回転させると、関節機構30は円弧状の軌跡を描き点aで投射光4を遮断し、点bで再び透過する。受光素子5は投射光4の光量に応じて電圧を発生する。遮断検出器8、透過検出器9は受光素子5の出力を増幅し、それぞれ遮断検出器8、透過検出器9内部の基準電圧と比較して遮断トリガ、透過トリガをそれぞれ発生させる。遮断トリガと透過トリガは回転角検出器10で検出されるX軸アクチュエータ33、Y軸アクチュエータ

34の基準点に対する a 点、b 点の回転角を角度メモリ 11へ格納する。格納された動作角の平均値を中点計算 機12で計算し第1の原点である中点 c を決定する。

【0022】図12は第2の原点検出動作時の関節機構 30の軌跡を示す図である。第2の原点検出は関節コン トローラ40でX軸アクチュエータ33、Y軸アクチュ エータ34を回転させ中点cまで移動させる。ここで、 X軸アクチュエータ33、Y軸アクチュエータ34を等 速逆方向に回転させると関節機構30は往復直線軌跡を 描き、点dで投射光4を遮断し、点d 'で再び透過す る。受光素子5は太陽電池等からなり、投射光4の光量 に応じて電圧を発生する。遮断検出器8、透過検出器9 は受光素子5の出力を増幅し、それぞれ遮断検出器8、 透過検出器9内部の基準電圧と比較し遮断トリガ、透過 トリガを発生させる。遮断トリガと透過トリガは回転角 検出器10で検出されるX軸アクチュエータ33、Y軸 アクチュエータ34の基準点に対する d点、d'点の回 転角を角度メモリ11へ格納する。格納された動作角の 平均値を中点計算機12で計算し第2の原点である中点 eを決定する。次に、第1の原点である中点c、第2の 原点である中点eによって関節機構30の機構原点が決 定する。なお、遮断検出器8、透過検出器9は第2の実 施の形態で示した投射光検出器20に変更しても同様に 機構原点を求めることができる。

[0023]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る原点検出装置によれば、2自由度の関節機構の機構原点を正確に求めることができる。その理由は取付け誤差、調整誤差を含むセンサを使用せず、関節機構の機構原点を空間に配置された投射器の投射光を用いて測定するためである。また、本発明によれば、関節機構の機構原点を測定する他の従来方式より安価に原点検出が可能である。その理由は従来方式がカメラ、画像処理装置を利用するのに対して投光器と受光素子で検出できるためである。さらに、本発明によれば、回路調整工数を少なくすることができる。その理由は第2の実施の形態で示した投射光検出器を用い、投射光の遮断と透過を1つの検出器で検出するためである。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態を示す概略構成図である。

【図2】 第1の原点検出動作時のパンーチルト機構の 軌跡を示す図である。

【図3】 第2の原点検出動作時のパンーチルト機構の 軌跡を示す図である。

【図4】 回転角検出器の動作を示すブロック図である。

【図5】 遮断検出器の動作を示すブロック図である。

【図6】 動作角メモリの動作を示すプロック図である。



【図8】 本発明の第2の実施の形態を示す概略構成図である。

【図9】 投射光検出器の動作を示すブロック図である。

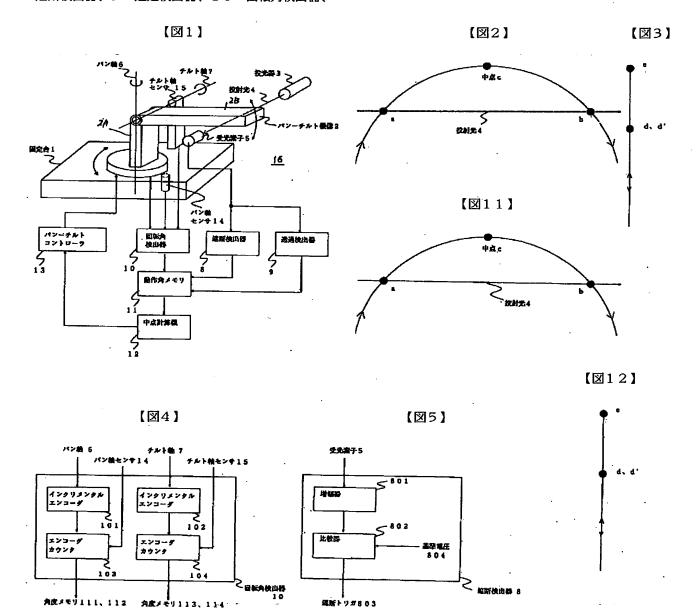
【図10】 本発明の第3の実施の形態を示す概略構成 図である。

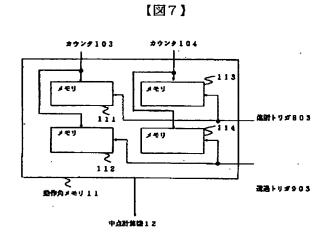
【図11】 第1の原点検出動作時の関節機構の軌跡を示す図である。

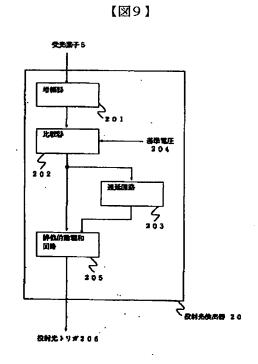
【図12】 第2の原点検出動作時の関節機構の軌跡を示す図である。

【符号の説明】

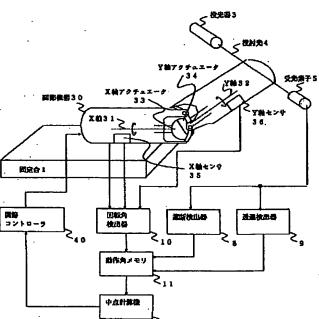
1…固定台、2…パンーチルト機構、3…投光器、4… 投射光、5…受光素子、6…パン軸、7…チルト軸、8 …遮断検出器、9…透過検出器、10…回転角検出器、 11…動作角メモリ、12…中点計算機、13…パンーチルトコントローラ、14…パン軸センサ、15…チルト軸センサ、20…投射光検出器、30…関節機構、31…X軸、32…Y軸、33…X軸アクチュエータ、34…Y軸アクチュエータ、35…X軸センサ、36…Y軸センサ、40…関節コントローラ、101,102…インクリメンタルエンコーダ、103,104…エンコーダカウンタ、111,112,113,114…メモリ、201…増幅器、202…比較器、203…遅延回路、204…基準電圧、205…排他的論理和回路、206…投射光トリガ、801…増幅器、802…比較器、803…遮断トリガ、804…基準電圧、901…増幅器、902…比較器、903…透過トリガ、904…基準電圧。











特爾平1003,29083